

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2006年3月9日 (09.03.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/025452 A1

- (51) 国際特許分類:
H01J 37/317 (2006.01) G02F 1/1337 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/015919
- (22) 国際出願日: 2005年8月31日 (31.08.2005)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2004-255648 2004年9月2日 (02.09.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日新イオン機器株式会社 (NISSIN ION EQUIPMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6018205 京都府京都市南区久世殿城町575番地 Kyoto (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安東 靖典 (ANDO, Yasunori) [JP/JP]; 〒6018205 京都府京都市南区久世殿城町575番地 日新イオン機器株式会社内 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 内藤 照雄, 外 (NAITO, Teruo et al.); 〒1076012 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル12階 信栄特許事務所 Tokyo (JP).

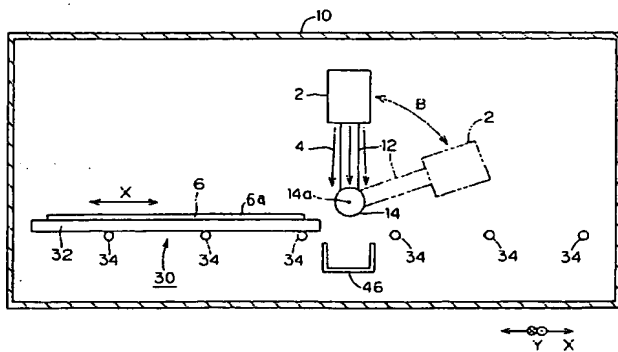
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: ION BEAM IRRADIATION APPARATUS AND ION BEAM IRRADIATION METHOD

(54) 発明の名称: イオンビーム照射装置およびイオンビーム照射方法



(57) Abstract: An ion beam irradiation apparatus is provided with a vacuum container (10), an ion source (2), a board driving mechanism (30), a rotating shaft (14), an arm (12) and a motor. The ion source (2) is provided in the vacuum container (10) and irradiates a board (6) with an ion beam (4) having a width wider than that of the board. The board driving mechanism (30) drives the board (6) to reciprocate in the vacuum container (10). The rotating shaft (14) has a center shaft (14a) separated from the ion source (2) but close to the board and is substantially parallel to the board surface. The arm (12) is provided in the vacuum container (10) and supports the ion source (2) from the rotating shaft (14). The motor is provided outside the vacuum container (10) and reciprocates and rotates the rotating shaft (14).

[続葉有]